# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

09-238287

(43)Date of publication of application: 09.09.1997

(51)Int.CI.

HO4N 5/335 H01L 27/146

(21)Application number: 08-042357 (22)Date of filing:

29.02.1996

(71)Applicant : NIKON CORP

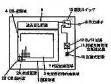
(72)Inventor: MATSUDA HIDEAKI

# (54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce number of manufacture processing stages and to allow the image pickup device to pick up correctly an image of an object.

SOLUTION: A middle part of a picture element area 1 is a valid picture element area 3 of a light receiving section and its outer circumferential parts are an OB(optical black) area 4. Each valid picture element 2A applies photoelectric conversion to an incident light into an image signal. On the other hand, A signal read from an OB part picture element 2B is a signal not corresponding to the incident light. A separate light shield picture element 10 is formed to a position other than the picture element area 1 and a metallic light shield film 11 for the separate light shield picture element is formed on the surface of the picture element 10. When a read circuit 6 reads a signal of the OB part picture element 2B, a changeover switch 13 is thrown to the position of an S/H circuit 12, from which a reference signal is outputted. On the other hand. when the read circuit 6 reads an image signal from the valid picture elements 2A, the changeover switch 13 is thrown to the position of the read circuit 6, and the image signal is outputted through the changeover switch 13.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平9-238287

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所
H 0 4 N 5/335			H 0 4 N 5/335	R
HO1L 27/146			HO1L 27/14	A

## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

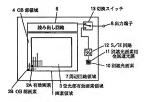
(21)出願番号	特顯平8-42357	(71)出職人	000004112
			株式会社ニコン
(22)出顧日 :	平成8年(1996)2月29日		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72)発明者	松田 英明
			東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
			式会社ニコン内
		(74)代理人	弁理士 福本 養維
			71 W
		į.	
		1	

### (54) 【発明の名称】 固体撮像装置

## (57)【要約】

【課題】 製造工程を減少させるとともに、被写体を正確に撮像できるようにする。 【解決手段】 画素領域1の中央部は受光部有効画素領

「解心すた」「剛高小型」(10 中大四地之下の中辺回流域 域3 さされてもかり、その外期部が0 日節領域 4 とされて いる。有効画素2 Aは、人男光を画像信号化光電変換す る。一方、0 日部画素2 B から読み出される信号は、人 射光に対応しない信号とされている。画素領域1 と別の 位置には、別聴光回素月金原速光鏡1 1 分形成されてもり、その表面 上には別速光画素用金属速光鏡1 1 分形成されてもり、その表面 たはは別速光画素用金属速光鏡1 1 分形成されてもり、その表面 たはは別速光画素用金属速光鏡1 1 分形成されてもり、その表面 たるり、指数に再か出力される一一方、読み出し回路6 が有効画素2 A の画像信号を読み出すとき、切り換えス イッチ1 3 が読み出し回路6 個に切り換えられ、画像信 号が出力される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光に対して光感度を有し、前記入射 光を画像信号に光電変換する、複数の画素を有する受光 手段と.

前記画素の各々で得られた前記画像信号を、所定の読み 出しタイミングで読み出す信号読み出し手段と、

前記受光手段とは別の位置に配置され、前記画像信号を 処理する場合に用いられる基準信号を生成する基準信号 生成手段とを備えることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】 前記基準信号生成手段は、 前記受光手段の前記画素と同一の構成の他の画素と、

前記他の画素への光の入射を規制する遮光膜とを備える ことを特徴とする請求項1に記載の固体損像装置。 【請求項3】 前記基準信号生成手段の生成する前記基

準信号を保持する信号保持手段をさらに備えることを特 徴とする請求項1または2に記載の固体撮像装置。 「請求項4] 入射光に対して光感度を有し、前記入射 光を画像信号に光電変換する、複数の画素を有する受光

手段と. 前記受光手段の外周部に配置され、前記入射光に対応し 20 スタ(以下、MISSITという)114によって構成 ない 所定のレベルの信号を出力する信号出力手段と

前記画像信号と、前記所定のレベルの信号を、所定の読 み出しタイミングで読み出す信号読み出し手段と、 前記受光手段及び信号出力手段とは別の位置に配置さ

れ、前記画像信号を処理する場合に用いられる暗電流成 分を含む信号を生成する生成手段とを備えることを特徴 とする固体撮像装置。

【請求項5】 前記信号出力手段の出力する前記所定の レベルの信号と、前記生成手段の生成する信号に含まれ る前記暗電流成分を用いて、前記画像信号を処理する場 30 れていない。 合に用いられる基準信号を生成する信号補正手段をさら に備えることを特徴とする請求項4に記載の固体撮像装

【請求項6】 前記信号出力手段は、光を遮光する遮光 障を有さず、かつ光感度を有しない複数の画素を備える ことを特徴とする請求項4または5に記載の間体構像装 置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [10001]

し、特に、オプティカル・ブラック部を画素領域の配置 位置と異なる位置に形成するようにした固体操像装置に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】固体撮像装置は、例えば、マトリクス状 に配置されている複数の画素に入射した光を画像信号に 光電変換することによって、被写体の画像を掃像する装 置である。

【0003】図7は、従来の固体損像装置の一構成例を 示す平面図である。本図に示す固体操像装置の画素領域 50 できるようになされている。

1には、複数の画素2がマトリクス状に配置されてい る。

【0004】との画素領域1の中央部は受光部有効画素 領域3とされており、複数の有効画素2Aによって形成 されている。一方、受光部有効画素領域3の外周部は、 オブティカル・ブラック部(以下、〇B部という)領域 4とされている。このOB部領域4に形成されているO B部画素2Bは、有効画素2Aと同一の構成を有してい るが、その上部の全面に、OB部金属遮光膜5が形成さ

10 れている。 【0005】受光部有効画素領域3の内部に形成されて

いる有効画素2Aは、被写体からの光を受光し、その光 を画像信号(信号電荷)に光電変換して出力するように なされている。

【0006】図8は、図7に示す有効画素2Aの一構成 例を示す断面図である。との有効画素2A-aは、被写 体からの光を受光して画像信号に光電変換する埋め込み フォトダイオード (以下、BPDという) 113、及び 画像信号を増幅して出力するMIS型静電誘導トランジ されている.

【0007】BPD113においては、p型基板101 の上部に形成されているn型ウェル102の上部にp-領域103が形成され、さらにp-領域103の上部に n\*領域104が形成されている。

【0008】 ここで、各ポリシリコン層(108, 10 9) を形成後に、BPD123の表面n\*領域(104 の表面部分)が形成されている。よって、第2層ポリシ リコンゲート108の下では、n\*領域104が形成さ

【0009】一方、MISSIT114においては、n 型ウェル102の上部にn\*領域107が形成されてお り、n・領域107の上部を開む形で第1層ポリシリコ ンゲート109が形成されている。

【0010】第2層ポリシリコンゲート108は、BP D113のp 節域103に蓄積されている。入射光に 対応する画像信号(信号電荷)をMISSIT114の 第1層ポリシリコンゲート109下に転送するようにな されており、p\*領域103の露出部分及び第1層ポリ 【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像装置に関 40 シリコンゲート109の両方に、その一部が重なる(上 下方向において)ように形成されている。

【0011】 さらに、MISSIT114で増幅された 画像信号を垂直方向に伝達する垂直信号線110が、M ISSIT114の上部の全面に形成されている。な お、この垂直信号線110はアルミニウムによって形成 されており、MISSIT114への光の入射を規制す るMISSIT遮光用アルミでもある。但し、この垂直 信号線110は、BPD113の上部には形成されてお らず、被写体からの光がBPD113に入射することが

【0012】被写体からの光がBPD113に入射する と、光電変換された画像信号(信号電荷)がp-領域1 03 に蓄積される。またとのとき、第1 層ポリシコンゲ ート109 (MISSIT114のゲート) には負電位 が印加されており、MISSIT114が遮断状態であ ると同時に、第1層ポリシリコンゲート109の下部は 反転機が誘起され n型領域となっている(図示せ ず)。

【0013】次に、第2層ポリシリコンゲート108 (転送スイッチのゲート) に所定のレベルの負電位が印 10 加されると、p-領域103に蓄積されている画像信号 (信号電荷)が、第2層ポリシリコンゲート108の下 に誘起されるpチャネル (図示せず) を介して、MIS SIT114 (第1層ポリシリコンゲート109の下部 に誘起されているp型反転層) に転送される。その後、 第2層ポリシリコンゲート108の電位をもとに戻し て、転送スイッチを遮断状態にする。続けて第1層ポリ シリコンゲート109 (MISSIT114のゲート) の電位を蓄積時よりも高い所定の電位にしてMISSI T114をオン状態にする。するとMISSIT114 に転送された画像信号(信号電荷)は増幅され、垂直信 暑線110を介して読み出し回路6に供給される。そし て、MISSIT114をリセットした後、再び蓄積状 態にする。

【0014】一方、OB部領域4に形成されているOB 部画素2 Bは、上記有効画素2 A とほぼ同一の構成を有 している。しかしながら、上述したように、OB部画素 2 Bの上部には、0 B部金属遮光膜5 が形成されてい 3.

【0015】図9は、OB部画素2Bの一構成例を示す 30 断面図である。とのOB部画素2B-aの構成は、図8 に示す有効画素 2 A - a の構成と基本的に同様である が、BPD113への光の入射を規制するOB部金属連 光膜5が、垂直信号線110の上部に、画素部全体を覆 うように形成されている。

【0016】従って、このOB部画素2B-aにおける BPD113は光感度を有さず、p-領域103には、 暗電流のみが蓄積される。垂直信号線110からは、B PD113の暗電流成分に対応したMISSIT114 の出力信号が出力される。すなわち、この信号は、被写 40 撮像することが困難になるという課題が生じる。 体の光に対応しない信号であり、有効画素 2 Aから読み 出された画像信号を処理する基準信号として用いられ る。なお、BPD113の暗電流成分は、BPD113 の温度に対応して変化する。

【0017】読み出し回路6は、画素領域1のすべての 画素2(有効画素2A及びOB部画素2B)の蓄積して いる信号(画像信号及び画像処理基準信号)を読み出 し、出力端子8から外部に出力する。画素領域1及び読 み出し回路6の周囲に配置されている周辺回路領域7に は、この固体撮像装置の動作を制御する所定の回路(例 50 【0025】本発明はこのような状況に鑑みてなされた

えば、読み出し回路6の制御回路等)が形成されてい る。

### [0018]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、固体 摄像装置が増幅型固体撮像装置である場合(各画素2が 信号を増幅する増幅部を有している場合)、OB部領域 4では、OB部会属遮光聴5を、垂直信号線110の上 側に、OB部画素2B-aの全面にわたって覆う必要が ある (BPD113への光の入射を規制するため)。

【0019】従って、従来の固体掃像装置においては、 OB部金属遮光膜5を形成する工程の分だけ煩雑さが増 加し、さらに製造工程の増加に伴って、歩留まりが悪化 するという課題がある。

【0020】また、OB部領域4内では、OB部金属連 光障5がOB部画素2Bの上部の全面に形成されてい る。一方、受光部有効画素領域3内の有効画素2Aの上 部には、金属遮光膜は形成されていない。とのため、O B部画素2Bの層の厚さが、有効画素2Aの層の厚さよ りも、〇B部金属遮光膜5の分だけ厚くなり、画素領域 20 1の表面が平坦でなくなってしまう。

【0021】との固体撮像装置を用いて、被写体をカラ ーで掃像する場合、カラーフィルタ、黒フィルタ等を画 素領域1の表面の全面に形成する。しかしながら、上記 のように、画素領域1の表面が平坦でない場合、カラー フィルタ等にも、受光部有効画素領域3とOB部画素領 域4で段差が生じてしまう。すると、特に受光部有効画 素領域3と0日部画素領域4の境界における光学的特性 が、中央部における光学的特性と異なるものとなり、均 一なカラー画像を得ることが困難になる。そこで、これ を防止するため、画素領域1の表面の全面に平坦化膜を

フィルタ等を形成するようにしている。 【0022】しかしながら、画素領域1の表面を充分に 平坦にするには、OB部金属遮光膜5がある分、さらに 上記平坦化膜を厚く形成する必要がある。平坦化膜が厚 くなると、平田化職の上面に形成されるカラーフィルタ 等が名画素2から離れた位置(高い位置)に形成され る。すると、1つの画素に、所望の光以外の光が斜め方 向から入射して混色が起きやすくなり、被写体を正確に

形成して表面を平坦にし、その平坦化膜の上面にカラー

【0023】同様に、複数のオンチップマイクロレンズ を平坦化膜の上面の各画素2に対応する位置に設ける場 合においても、上記理由により混色が起きやすくなり、 さらに、斜め入射光の集光率も悪くなってしまう。 【0024】さらに、OB部領域4に形成されている各 OB部画素2Bの、各々の特性のバラツキに対応して、 O B部画素2 Bから出力される基準信号にもバラッキが 生じ、画像信号を正確に処理することが困難になるとい

う課題もある。

ものであり、製造工程を減少させるとともに、被写体を 正確に撮像することができるようにすることを目的とす

### [0026]

- 【課題を解決するための手段】請求項1に記載の固体撮 像装置は、入射光に対して光感度を有し、入射光を画像 信号に光電変換する、複数の画素を有する受光手段と、 画素の各々で得られた画像信号を、所定の読み出しタイ ミングで読み出す信号読み出し手段と、受光手段とは別 の位置に配置され、画像信号を処理する場合に用いられ 10 2は、別遮光画素10に蓄積される信号(基準信号) る基準信号を生成する基準信号生成手段とを備えること を特徴とする。
- 【0027】請求項4に記載の固体撮像装置は、入射光 に対して光感度を有し、入射光を画像信号に光電変換す る、複数の画素を有する受光手段と、受光手段の外周部 に配置され、入射光に対応しない、所定のレベルの信号 を出力する信号出力手段と、画像信号と、所定のレベル の信号を、所定の読み出しタイミングで読み出す信号読 み出し手段と、受光手段及び信号出力手段とは別の位置 に配置され、画像信号を処理する場合に用いられる暗電 20 流成分を含む信号を生成する生成手段とを備えることを 特徴とする。
- 【0028】請求項1に記載の固体摄像装置において は、受光手段が入射光を画像信号に光電変換し、信号読 み出し手段が受光手段の光電変換した画像信号を所定の タイミングで読み出す。基準信号生成手段は、受光手段 とは別の位置に配置され、画像信号を処理する場合に用 いられる基準信号を生成する。従って、OB部領域にお ける遮光膜が不要となり、それに起因する弊害が除去さ ns.
- 【0029】請求項4に記載の固体撮像装置において は、受光手段が入射光を画像信号に光電変換し、信号出 力手段は、入射光に対応しない所定のレベルの信号を出 力する。信号読み出し手段が受光手段の光電変換した画 像信号と信号出力手段の出力する所定のレベルの信号を 所定のタイミングで読み出す。生成手段は、受光手段及 び信号生成手段とは別の位置に配置され、画像信号を処 理する場合に用いられる暗電流成分を含む信号を生成す る。従って、OB部領域における遮光膜が不要となり、 それに起因する弊害が除去される。

### [0030]

- 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面を参 照して説明する。なお、従来の場合と対応する部分には 同一の符号を付し、その説明は適宜省略する。
- 【0031】図1は、本発明を適用した固体撮像装置の 一実施例の機成を示す平面図である。本実施例の固体撮 像装置の構成は、図7に示す従来の固体撮像装置の構成 と基本的に同様であり、以下に示す構成が異なってい る。すなわち、本実施例の固体撮像装置においては、O

- が形成されていない。また、OB部画素2Bの構成が、 有効画素2 Aの様成と異なっている(との点について は、図2乃至図4を参照して後述する)。
- 【0032】さらに、本実施例においては、有効画素2 Aと同一の構成を有する別遮光画素 10が、周辺回路領 域7の所定の位置(画素領域1とは別の位置)に形成さ れており、その別進光画素 10の 上部には、アルミ等よ りなる別遮光画素用金属遮光膜11が形成されている。 サンブル/ホールド回路(以下、S/H回路という)1 を、所定のタイミングでサンプリングして保持するよう
- 【0033】読み出し回路6の後段には、切り換えスイ ッチ13が配置されており、読み出し回路6の出力する 信号とS / H回路12の出力する信号を、所定のタイミ ングで切り換えて出力端子8を介して外部に出力するよ うになされている。

**になされている。** 

- 【0034】とこで、本実施例における有効画素2Aの 構成とOB部画素2Bの構成の違いについて説明する。 【0035】本実施例における有効画素2Aは、図7に 示す場合と同様に、例えば、図8に示す有効画素2Aaと同一の機成を有している。
  - 【0036】一方、本実施例のOB部画素2Bは、例え ば以下に示すような構成を有している。
  - 【0037】図2は、本実施例のOB部画素2Bの第1 の構成例を示す断面図である。本図に示すOB部画素2 B-Xの構成は、図8に示す有効画素2A-aの構成と 基本的に同様であるが、図8に示すBPD113(その n-領域103)が形成されていない点が異なってい
- 30 る。すなわち、このOB部画素2B-Xは、入射光を信 号電荷に光電変換することができない(光感度を有しな は)、従って、OB部画素2B-Xが出力する信号は、 入射光に対応しない、所定のレベルの信号(BPDに蓄 積された信号電荷が0の場合のMISSIT114の出 力信号) である。つまり、このOB部画素2B-Xの上 部に、光の入射を規制するOB部金属遮光膜を形成する 必要がなくなる。
- 【0038】図3は、本実施例のOB部画素2Bの第2 の構成例を示す断面図である。本図に示すOB部画素2 40 B-Yの構成は、図8に示す有効画素2A-aの構成と 基本的に同様であるが、第2層ポリシリコンゲート10 8が、上面から見て、BPD113に重ならないように 形成されている。また、BPD113の表面のn'型不 純物領域104が、p-型不純物領域103の上部の全 面に形成されている。
- 【0039】従って、BPD113のp<sup>-</sup>領域103に 蓄積されている、入射光に対応する信号電荷が、出力段 であるMISSIT114に転送されない(第2層ポリ シリコンゲート108の下に誘起されるPチャンネルと B部画素2Bへの光の入射を規制する○B部金属遮光膜 50 BPD113のp~領域103が接しないので、p~領域

103に蓄積されている電荷が転送スイッチを介して転 送されないため)。従って、OB部画素2B-Yが出力 する信号は、入射光に対応しない、所定のレベルの信号 (信号電荷0の場合のM1SS1T114の出力信号) である。つまり、このOB部画素2B-Yの上部に、O B部金属進光膜を形成する必要がなくなる。

【0040】図4は、本実施例のOB部画素2Bの第3 の構成例を示す断面図である。本図に示すOB部画素2 B-Zの構成は、図8に示す有効画素2A-aの構成と aを、BPD113の上部に配置している(すなわち、 第2層ポリシリコン配線108aは、転送スイッチのゲ ートとして使用されない)。つまり、BPD113とM 1SSIT114の間に、転送スイッチそのものが形成 されていない。

【0041】従って、本実施例においては、BPD11 3のp 領域103に蓄積されている信号電荷がMIS SIT114に転送されない。従って、OB部画素2B - Zが出力する信号は、入射光に対応しない、所定のレ ベルの信号(信号電荷が0の場合のM1SS1T114 20 の出力信号) である。つまり、このOB部画素2B-Z の上部に、OB部金属遮光膜2を形成する必要がなくな

【0042】また、別遮光画素10の上部に形成されて いる別遮光画素用金属遮光隙11は、画素領域1内の各 画素2の垂直信号線110をBPD113の上部に延長 することによって形成されている。すなわち、本実施例 においては、別進光画素用金属遮光膜11を形成するた めの層を新たに増やす必要はない。

【0043】次に、本実施例の固体撮像装置の動作につ 30 れるので、より正確な画像を得ることができる。 いて説明する。

【0044】被写体からの光が画素領域 1 に入射する と、受光部有効画素領域3内の有効画素2Aは、その入 射光を信号電荷に光電変換して蓄積する。〇B部画素2 Bが、図3及び図4にそれぞれ示すOB部画素2B-Y. 2B-7である場合においては、OB部画素2B も、被写体からの光を信号電荷に光電変換して蓄積す る。一方、OB部画素2Bが図2に示すOB部画素2B -Xとされている場合においては、光電変換が行われな

【0045】なお、このとき、別遮光画素10には、光 は入射していない。

【0046】読み出し回路6は画素領域1内の各画素2 に蓄積されている信号を左下から右上に、<br />
順に読み出 す。読み出し回路6がOB部画素2Bの信号を読み出し ているとき、切り換えスイッチ13はS/H回路12側 に切り換えられ、S/H回路12に保持されている別連 光画素 10の基準信号が出力端子8を介して外部に出力 される。

【0047】なお、上述したように、別遮光画素10

は、有効画素2Aと同一の構成を有しているので、暗電 流成分に対応する信号を生成するには、電荷の蓄積時間 を有効画素2Aと同一にする必要がある。従って、S/ H回路12は、別進光画素10に有効画素2Aと同一の 時間だけ電荷が蓄積されたとき、これを基準信号(BP D113の暗電流成分に対応したM1SS1T114の 出力信号) としてサンプリングし、1フレームまたは1 フィールド(1画面)の期間、保持している。

【0048】従って、出力端子8を介して外部に出力さ 基本的に同様であるが、第2層ボリシリコン配線108 10 れる基準信号は、1つの別源光画素10からサンプリン グされたものであり、そのレベルは、同一画面内におい ては、常に一定とされるので、基準信号のレベルのバラ ツキが抑制されている。

> 【0049】一方、読み出し同路6が有効画素2Aの著 積している信号(画像信号)を読み出すとき、切り換え スイッチ13は、読み出し回路6側に切り換えられる。 とれにより、読み出し同路6に読み出された各有効画素 2 Aの画像信号が、出力端子8を介して外部に出力され

【0050】なお、読み出し回路6、S/H回路12、 切り換えスイッチ13等は、周辺回路領域7に配置され ている、関示せぬ制御回路によって制御されている。 【0051】出力端子8を介して外部に出力された画像 信号は、別遮光画素10の生成した基準信号を用いて処 理される。上述したように、この基準信号は、BPD1 13の暗電流成分を含んでおり、さらに、1つの画素 (別遮光画素10)から抽出した信号である。従って、 受光部有効画素領域3から読み出された1画面分の画像 信号が、バラツキのない有効な基準信号によって処理さ

【0052】以上のように、本実施例においては、OB 部画素2 Bの 上部に O B部金属遮光膜を形成しないよう にしたので、OB部金属遮光膜の形成工程が削除されて 煩雑さが減少する。また、製造工程の減少に伴い、歩留 まりの悪化を抑制することができる。さらに、OB部領 域4の厚さと受光部有効画素領域3の厚さが等しくなる ので、平坦化膜を厚することなく、カラーフィルタ等を 画素領域1の全面に形成することができ、被写体を正確 に撮像することができる。

【0053】図5は、本発明を適用した固体撮像装置の 他の実施例の構成を示す平面図である。本実施例の固体 撮像装置の構成は、図1に示す固体撮像装置の構成と基 本的に同様であり、以下に示す構成が異なっている。 【0054】すなわち、本実施例の関体撮像装置におい ては、画素領域1の内部のすべての画素が有効画素2A とされている。つまり、OB部画素2B(OB部領域 4) が形成されておらず、画素領域1が全て受光部有効 画素領域3とされており、図1の実施例に較べて、受光 部がより大きくされている。なお、その他の構成は、図 50 1に示す場合と同様である。

【0055】本実施例においては、読み出し回路6の読 み出し動作を図1に示す場合から変更する必要がある。 つまり、本実施例の場合、読み出し回路6から出力され る信号は、すべて被写体の画像信号であり、この画像信 号を処理するために用いられる基準信号が含まれていな い。そとで、本実施例においては、読み出し同路6及び 切り換えスイッチ13は、以下のように動作する。

【0056】すなわち、読み出し回路6は、受光部有効 画素領域3 (画素領域1)の水平方向の1ライン分の有 効画素2Aを読み終わった後、また、1画面分の有効画 10 信号は、MISSIT114のリセット信号とBPD1 素2Aを読み終わった後、受光部有効画素領域3の外周 部の〇B部領域の読み出し期間に対応する期間、画像信 号の読み出し動作を中断する。

【0057】S/H回路12は、図1に示す場合と同様 に、別應光画素10で生成された基準信号を1画面毎に サンプリングして保持している。そして、読み出し回路 6が画像信号の読み出し動作を行わないとき、切り換え スイッチ13がS/H同路12側に切り換えられ、S/ H回路12に保持されている基準信号が出力端子8を介 して外部に出力される。

【0058】一方、読み出し同路6が受光部有効画素領 域3から画像信号を読み出しているとき、切り換えスイ ッチ13は読み出し回路6側に切り換えられ、読み出し 同路6の読み出した画像信号が出力端子8を介して外部 に出力される。

【0059】本実施例においては、画素領域1のすべて を受光部有効画素領域3としたので、有効画素数を増加 させることができる。

【0060】図6は、本発明を適用した固体損像装置の さらに他の実施例の構成を示す平面図である。本実施例 30 号を検出することができる。 の固体撮像装置の構成は、図1に示す固体撮像装置の構 成と基本的に同様であるが、以下に示す構成が異なって

【0061】すなわち、本実施例の固体撮像装置におい ては、S/H回路12の後段に補正回路20が設けられ ており、読み出し回路6の読み出した信号のうち、OB 部画素2Bから読み出した信号が補正同路20に入力さ れるようになされている。また、この補正回路20に は、S/H回路12の保持している信号も入力される。 【0062】スイッチ13は、読み出し同路6が有効画 40 素2Aの画像信号を読み出しているとき、読み出し回路 6側に切り換えられ、読み出し回路6顔B部画素2Bの 信号を読み出しているとき、補正回路20側に切り換え られる.

【0063】すなわち、読み出し回路6の読み出した信 号のうち、有効画素2Aから読み出した画像信号は、補 正回路20に入力されず、出力端子8を介して外部に出 力される。

【0064】補正回路20は、読み出し回路6から入力 された信号(OB部画素2Bから読み出された信号)

10 を、S/H回路12から入力された信号(別遮光画素1 0から読み出された信号)を用いて補正し、補正した信 号を基準信号として、出力端子8を介して外部に出力す るようになされている。

【0065】すなわち、OB部画素2Bの出力する信号 は、OB部画素2Bに入射した光に対応しない、所定の レベル (信号電荷が0の場合のMISSIT114の出 カレベル)の信号であり、BPD113の暗電流成分を 含んでいない。一方、別遮光画素 10 から読み出される 13の暗電流を加算した信号である。

【0066】本実施例における補正回路20は、別遮光 画素10から読み出された信号に含まれている案電流成 **分を利用して○B部画素2Bから読み出された信号を補** 正して基準信号を生成する。この基準信号は、図1及び 図5に示す場合と同様に、別遮光場祖10のBPD11 3の暗電液成分を含む、バラッキのない基準信号である ので、画像信号をより正確に処理することができる。

【0067】以上の実施例においては、画素領域1と異 20 なる位置に、1つの別遮光画素10を配置し、その別遮 光画素10の上部に別遮光画素用金属遮光膜11を形成 するようにしているが、例えば、3×3の複数の画素を マトリクス状に配置し、その少なくとも中央部の画素の 上部に遮光膜を形成し、その周囲の画素をダミー画素と し、その中央の画素を別遮光画素として用いるようにし てもよい。このように、基準信号を出力する画素(別述 光画素) の周囲に他の画素 (ダミー画素) を配置するこ とによって、有効画素と別遮光画素の形成条件を問一に することができ、より正確に、暗電流成分を含む基準信

【0068】また、以上の実施例においては、BPDの 出力段にMISSITを設け、増幅型固体撮像装置とし ているが、これに限らず、例えば、BPDの出力段にC CDを設けるようにしてもよい。また、切り換えスイッ チ、S/H回路、補正回路等が素子の内部(画素領域の 周辺部) に形成されているが、これらの同路を素子の外 部に形成するようにしてもよい。

#### [0069]

【発明の効果】以上のように、請求項1に記載の固体撮 像装置によれば、画像信号を処理する場合に用いられる 基準信号を生成する基準信号生成手段を、受光手段とは 別の位置に配置するようにしたので、製造工程を減少さ せることができるとともに、被写体をより正確に撮像す ることができる。

【0070】請求項4に記載の固体撮像装置によれば、 受光手段及び信号出力手段とは別の位置に配置される生 成手段の生成する信号を利用して、画像信号を処理する 場合に用いられる基準信号を生成するようにしたので、 製造工程を減少させることができるとともに、被写体を 50 より正確に撮像することができる。

12

【図面の簡単な説明】

11 【図1】本発明を適用した固体撮像装置の実施例の構成 を示す平面図である。

【図2】図1に示すOB部画素2Bの構成例を示す断面 図である。

【図3】図1に示すOB部画素2Bの他の構成例を示す 断面図である。

【図4】図1に示すOB部画素2Bのさらに他の構成例

を示す断面図である。 【図5】本発明を適用した固体操像装置の他の実施例の 10 12 S/H回路

構成を示す平面図である。 【図6】本発明を適用した固体撮像装置のさらに他の実

施例の構成を示す平面図である。

【図7】従来の固体撮像装置の一構成例を示す平面図で ある.

【図8】図7に示す有効画素2Aの構成例を示す断面図

[図9] 図7に示すOB部画素2Bの構成例を示す断面 図である。

【符号の説明】

1 画素領域 2 画素

2 A 有効画素

\*2B OB部画素

3 受光部有効画素領域 4 〇B部領域

5 OB部金属遮光膜

6 読み出し回路

7 周辺回路領域

8 出力端子

10 別遮光画素

11 別遮光画素用金属遮光膜

13 切り換えスイッチ

20 補正同路

101 p型基板 102 n型ウェル

103 p-領域

104 n\*領域

108 第2層ポリシリコンゲート

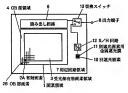
108a 第2層ポリシリコン配線

109 第1層ポリシリコンゲート 20 110 垂直信号線

113 RPD

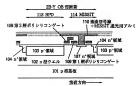
114 MISSIT

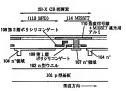
[図2]



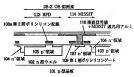
[図1]







[図4]



港直方向----

